

マスク・ウェハ検査用対物レンズ

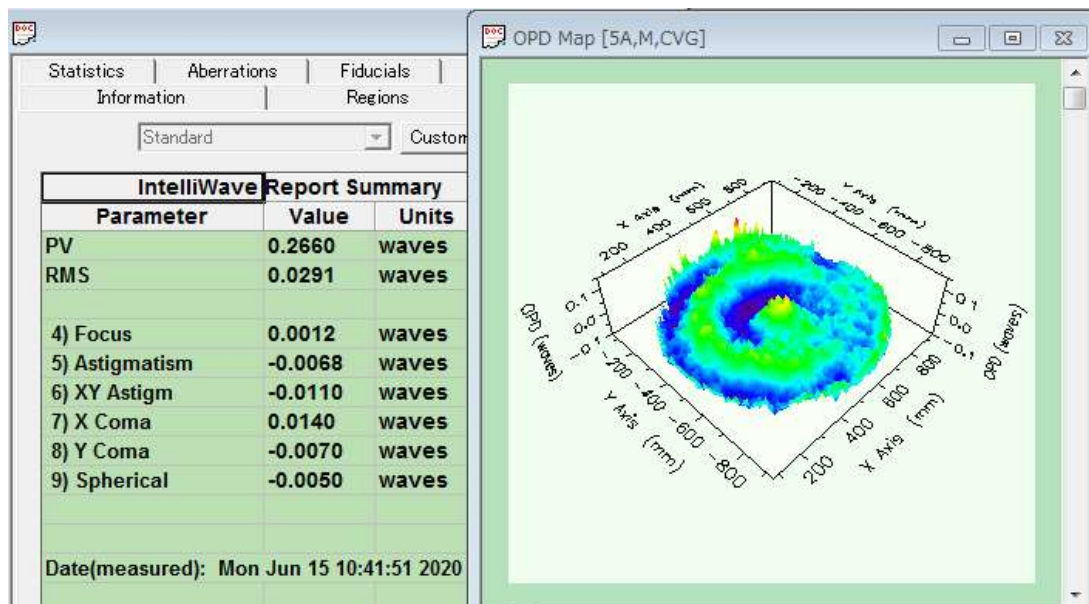
特長

- ◎屈折光学系なので無遮蔽・長作動距離です。
- ◎レーザーのスペクトル内で色消ししているので、良好な結像特性が得られます。
- ◎干渉計により波面収差を測定して設計性能を数値保証します。
- ◎半導体マスク・ウェハ観察用途に適しています。



マスク・ウェハ検査用対物レンズMIシリーズは広視野・長作動距離と無収差を両立し、半導体フォトマスク・ウェハ検査に適しています。
各種リレーレンズのカスタム対応可能です。

●透過波面収差評価例(MI266-5085)



オプティクス、レーザ、精密光学機器のリーディングカンパニー

KYOCERA 京セラSOC株式会社

お問い合わせ

TEL : 045-931-6592

<https://www.ksoc.co.jp/shiryo/>

担当：営業部 小林・木村 宛

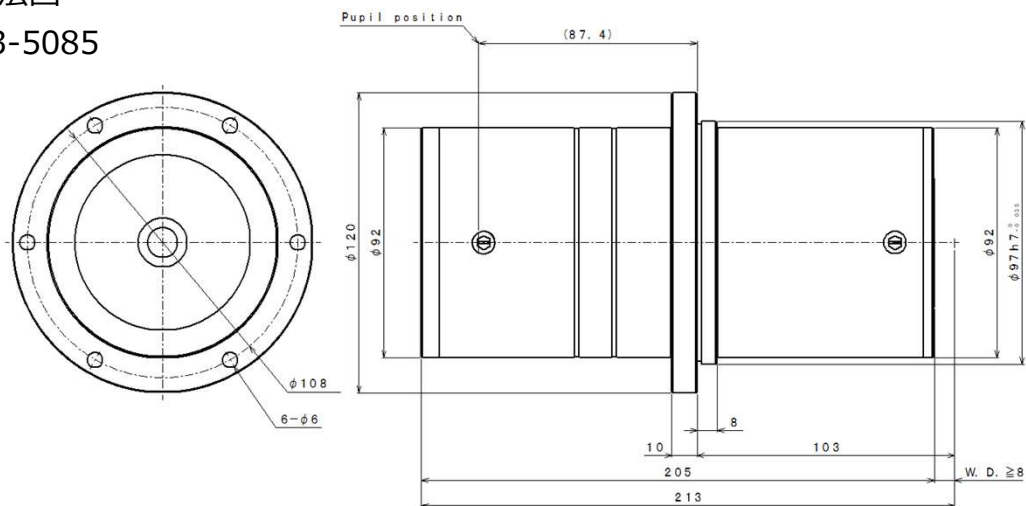


●ラインナップ

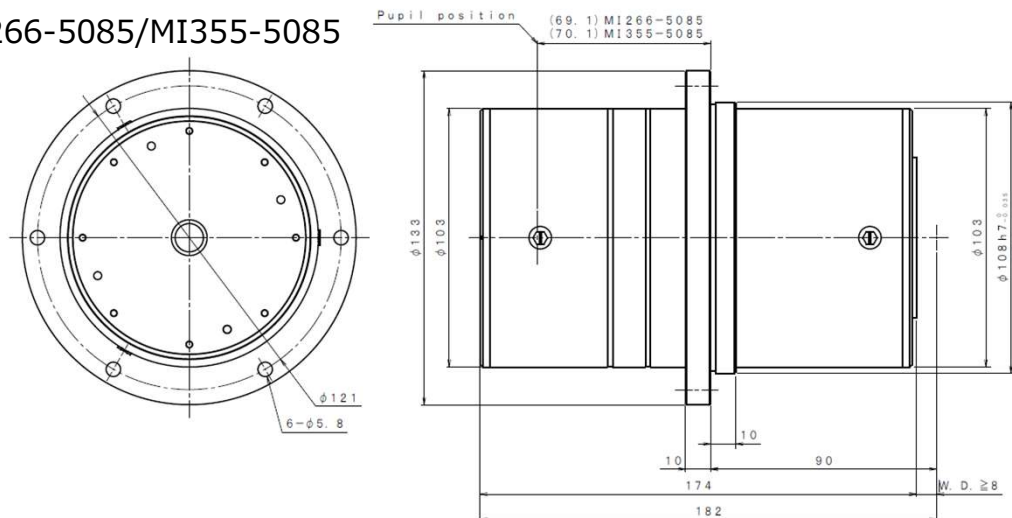
モデル名	MI193-5085	MI266-5085	MI355-5085
波長	193.4nm	266nm	355nm
バンド幅（半値全幅）	8pm	5pm	20pm
タイプ	屈折型		
開口数（NA）	0.85		
焦点距離	5mm		
透過率	≥ 70%	≥ 80%	
視野	Φ0.3mm	Φ0.45mm	
波面収差（軸上単色）	≤ 0.03 waves rms		
作動距離	≥ 8mm		
重量	約6.5kg	約7.1kg	約7kg
使用環境温度	23±0.5℃		

●外形寸法図

MI193-5085



MI266-5085/MI355-5085



本資料の内容は予告なく変更する場合があります。詳細についてはお問合せください。

オプティクス、レーザ、精密光学機器のリーディングカンパニー

KYOCERA 京セラSOC株式会社

お問い合わせ

TEL : 045-931-6592

<https://www.ksoc.co.jp/shiryo/>

担当：営業部 小林・木村 宛

